

HVPE에 의해 성장된 Zn 가 첨가된 GaN의 특성

The properties of Zn doped GaN grown by HVPE

정성훈*, 김우람, 흥필영, 문동찬
김선태

광운대학교 전자재료공학과
대전산업대학교 재료공학과

Sung-Hoon Chung*, Woo-Ram Kim, Pil-Young Hong, Dong-Chan Moon
Dept. of Electronic Materials Eng., Kwangwoon University
Seon-Tae Kim
Dept. of Materials Eng., Taejon National University of Technology

Abstract

In spite of the addition of Zn, a high quality of Zn-doped GaN film were prepared. The growth rates of Zn-doped GaN films were varied from $0.14\mu\text{m}/\text{min}$ to $0.05\mu\text{m}/\text{min}$ according to the amount of Zn incorporated. The smallest value of the FWHM of x-ray rocking curve was 407 arcsec. The Zn-related Photoluminescence emission peaks which occurred at 2.927 and 2.824 eV shifted toward the low energy region by increasing Zn partial pressures. It was compared between the intensities of D-A pair(3.259eV) and that of the exciton bound to acceptor band($E_{X,A}=3.449\text{eV}$).

I. 서 론

Zn는 비교적 증기압이 높기 때문에 첨가물을 열분해하여 주입하는 HVPE 장치에서는 주입량의 조절이 용이하여 제작되는 시편의 재현성이 높다. 본 실험에서는 첨가과정에서의 이러한 장점을 이용하여 시편의 불순물 양에 따른 광 방출 피크간의 상호변화관계와 결정성에 미치는 영향을 관찰하였다.

II. 실 험

열분해된 첨가물을 독립된 주입관을 통해 HVPE 장치의 반응로내에 주입하였다. 불순물의 온도와 운송가스의 양을 조절하여 Zn 분압을 5.0×10^{-7} 에서 4.9×10^{-4} atm. 까지 변화시켰다. Undoped GaN 제작시 최적조건인 HCl 10 sccm, NH₃,

500 sccm, Ga 18cc, N₂ 3000 sccm으로 GaN를 성장하면서 Zn를 첨가하였다. 열처리는 위의 반응로에서 N₂를 3000 sccm 흘리면서 700°C에서 20분간 행하였다. 제작된 시편의 결정성 조사를 위하여 이중결정 X선 회절기 (Double crystal x-ray diffractometer)를 사용하였으며 SEM에 의한 단면촬영으로 성장율을 결정하였다. He-Cd laser를 사용하여 12K에서 광방출 특성을 조사하였다.

III. 결과 및 고찰

1. Zn 첨가된 GaN의 결정성

Zn가 첨가된 GaN의 성장율은 그림 1과 같이 Zn 분압(P_{Zn})이 증가함에 따라 감소하는 경향을 나타내었다. 이것은 Zn의 유입이 Gallium과 Nitrogen의 결합을 방해하기 때문으로 생각되며 성장율이 급격한 감소후에 완만해지는 현상은 Zn 첨가량이

증가할수록 막의 구조적인 특성에 미치는 영향이 감소하기 때문으로 해석된다. 이러한 현상은

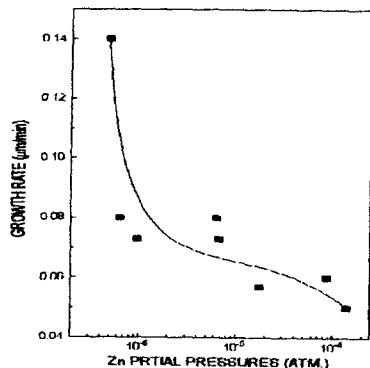


Fig. 1 Growth rates as a function of Zn partial pressures

그림 2의 이중 결정 X선 회절기에서 얻어진 θ mode의 반치폭 변화와 일치한다. Zn 분압이 증가함에 따라 반치폭이 증가하는 기울기가 감소하고 있다. 위의 결과와 Nobuo Itoh 등⁽¹⁾이 보고한 반치폭과 막의 결정성의 관계에 의해서 Zn 첨가에 의해 격자왜곡이 발생함을 알 수 있다. 본 실험에서 성장된 undoped GaN의 반치폭은 374 arcsec로서 양호한 결정성을 보였다.

격자의 왜곡현상을 조사하기 위하여 X선 회절기의 θ -2 θ mode에서 얻어진 GaN(00.4) 회절패턴의 반치폭을 이용하여 undoped 시편에 대한 strain을 구하였다.⁽²⁾ 그림 3에서와 같이 Zn 분압에 따라 strain이 증가하는 것을 볼수 있으며 특히 10^{-6} Torr 부근의 낮은 분압영역에서 급격한 값의 증가를 확인할 수 있는데 이 현상은 앞서 언급한 Zn 분압에 따른 결정질의 저하현상과 일치하였다.

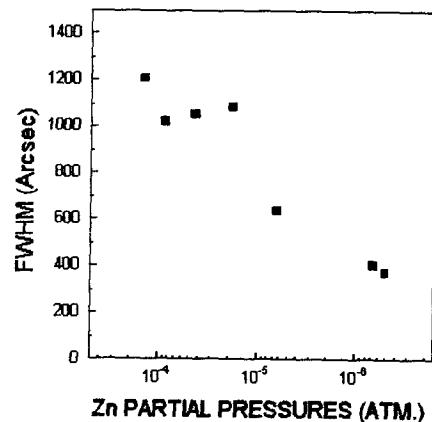


Fig. 2 Double crystal X-ray linewidths as a function of Zn partial pressures.

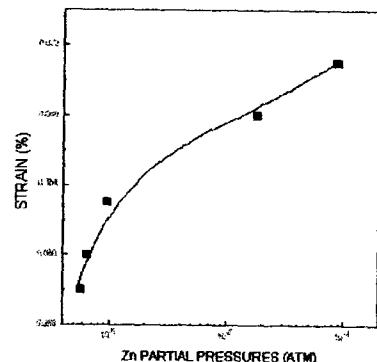


Fig. 3 Strain ratios of Zn doped GaN to undoped GaN

Zn-GaN의 (00.4)peak에 의해 산출된 격자상수는 Zn 분압의 증가에 따라 $c=5.1941\text{--}5.2138\text{\AA}$ 으로 전형적인 c 값⁽³⁾인 5.1855\AA 보다 큰 값을 보였다. 그러므로 Zn-GaN 시편은 Zn 분압 증가에 따라 c 축면에 평행한 방향으로 compression strain이 증가함을 알 수 있었다.

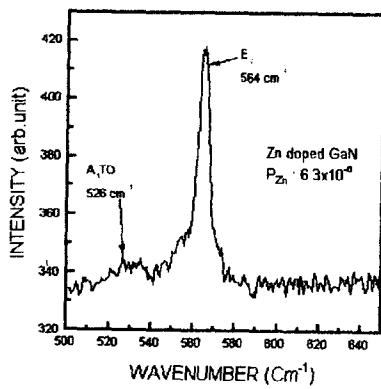


Fig. 4 Raman spectra of Zn doped GaN

Zn 가 첨가된 GaN 시편의 Raman 분광을 그림 4에 나타내었다. Zn 분압이 증가함에 따라 결정질을 나타내는 E₂ (high) band의 강도는 감소하는 경향을 나타내었다.

2. Zn 가 첨가된 GaN의 광학적 특성

2-1. 3.475, 3.449 eV 밴드의 변화

undoped GaN의 경우 3.475eV에서 강하게 나타나는 exciton bound to donor (E_{X-D}) 밴드가 주 피크

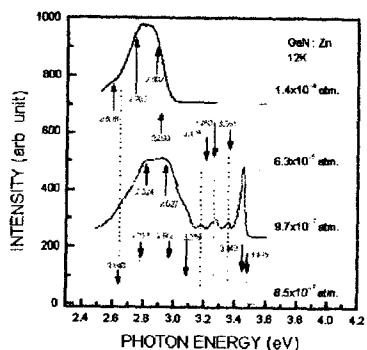


Fig. 5 Photoluminescence spectra from Zn doped GaN grown at different Zn partial pressures

를 이룬다.

그림 4에서 3.475eV의 밴드가 Zn의 첨가량이 증가함에 따라 감소하다가 Zn 분압(P_{Zn})이 9.7×10^{-7} atm.의 조건에서는 완전히 소멸됨을 알 수 있다. 그러나 동일조건에서 exciton bound acceptor(E_{X-A})에 의해 3.449eV에서 발생한 밴드는 강도면에서 반대의 경향을 보인다. 그러나 Zn 분압이 1.85×10^{-5} atm. 이상의 조건에서는 점차 감소하다가 소멸하게 된다.

2-2. 3.351eV 밴드에 대한 고찰

3.351eV에서 발생한 밴드는 S.W. Brown⁽⁴⁾에 의해 exciton bound center로 보고된 바 있다. 본 실험에서는 이전 보고와 상이한 결과를 보이는데 즉, 3.449eV와 3.351eV 밴드는 분압이 변화함에 따라 강도면에서 동일한 경향을 보이며 또한 E_{X-A} 밴드와 비교해서 약 100meV 정도 떨어진 곳에서 발생함으로써 3.351eV 밴드의 phonon의 가능성이 있다. 이상의 밴드외에도 저에너지 영역에 수 개의 밴드를 볼 수 있는데 특히 3.259eV의 피크는 residual donor와 acceptor의 D-A pair 재결합에 의해 발생하는 것으로 M. Illegems⁽⁵⁾등에 의한 보고가 있다. 이 피크는 6.3×10^{-6} Torr 이하에서는 그림 6과 같이 exciton bound acceptor와 반대의 강도변화를 보이는데 특히 전자의 경우 residual donor에 의해 발생하는 D-A pair가 Zn에 의해 defect center가 보상됨으로써 광방출 강도가 감소하는 것으로 생각된다. 한편 3.259, 3.175, 3.078eV 밴드는 D-A 피크의 phonon replicas이다.

IV. 결 론

결정성은 Zn의 첨가량이 증가함에 따라 감소하는 경향을 보였으며 격자상수 및 strain의 증가로 c축면방향에 평행하게 작용하는 compression strain의 영향을 확인할 수 있었다. Raman 분광의 E₂(high) mode의 강도는 분압과 반비례하는 경향

을 보였다. D-A pair 피크는 Zn 분압이 증가함에 따라 감소하는 경향을 보였다. 분압의 변화에 따른 D-A peak 와 E_{X-A} 밴드강도의 반대 경향은 Zn에 의한 donor center의 보상에 기인한 것으로 생각한다. 3.35eV 밴드의 E_{X-A} phonon 가능성은 E_{X-A} 밴드와 강도면에서 동일한 경향을 보이고 약 100meV의 큰 에너지 차이를 보이는데 기인한다.

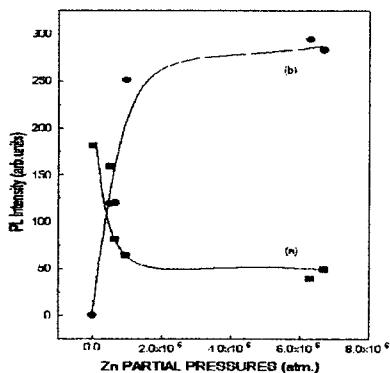


Fig. 6 Variation of the PL emission intensities with Zn partial pressures
(a) D-A pair
(b) Exciton bound to acceptor

참고문헌

- (1) Nobuo Itoh and Keiichi Okamoto. "A new technique for crystallographic characterization of heteroepitaxial crystal films" J. Appl. Phys. Vol.63, No.5, pp1486 ~ 1493. March 1988.
- (2) A. J. C. Wilson., Proc. Phys. Soc. Vol.81, No. 41. 1963
- (3) C. M. Balkas, C. Basceri and R. F. Davis, Powder Diffraction Vol.10, pp266. 1995
- (4) C. H. Hong, D. Pavlidis, S. W. Brown, and S. C. Rand., "Photoluminescence investigation of GaN films grown by metalorganic vapor

- vapor deposition on (100) GaAs", J. Appl. Phys. Vol.77, No.4, pp1705~1709. 1995
- (5) M. Illegems, R. Dingle, and R. A. Logan, "Luminescence of Zn- and Cd-doped GaN" J. Appl. Phys. Vol.43, No. 9, pp3797 ~ 3800. September 1972.